



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种孔径和厚度可控、通孔阳极氧化铝膜的制备方法

文献类型: 专利

作者 侯鹏翔, 石超, 刘畅 and 成会明

发表日期 2011-12-14

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及阳极氧化铝膜的制备技术,具体为一种制备小孔径、超薄、孔径和厚度可控的通孔阳极氧化铝膜的方法。以高纯铝为阳极,在硫酸的电解液中施加一定的恒压直流电源进行阳极氧化,选择适当的阴阳极间电压、电解液浓度、电解液温度及阳极氧化时间,反应后将带有铝基体的阳极氧化铝作为阳极,置于高氯酸和丙酮的混合液中,在高于阳极氧化电压5-15V的电压下阳极电解处理,使氧化铝膜与铝基体分离且同时去除阻挡层,从而得到小孔径、孔径和厚度可控且通孔的阳极氧化铝膜。本发明实现了小孔径、通孔阳极氧化铝膜的大量、简单、无损、均匀、规模制备,解决了目前无法获得小直径、超薄、通孔阳极氧化铝膜的技术难题。

公开日期 2011-12-14

语种 中文

专利申请号 CN102277607A

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/67173>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 侯鹏翔, 石超, 刘畅 and 成会明. 一种孔径和厚度可控、通孔阳极氧化铝膜的制备方法. 2011-12-14.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

108

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。